2017年秋の大会

放射線工学部会セッション

超伝導検出器の最新情報

The latest development of superconducting detector

(1) 超伝導トンネル接合放射線検出器を用いた材料分析

(1) Material analysis by superconducting tunnel junction X-ray detectors

*浮辺 雅宏¹, 志岐 成友¹, 全 伸幸¹, 藤井 剛¹, 大久保 雅隆¹, 北島 義典²

1産業技術総合研究所,2高エネルギー加速器研究機構

1. はじめに

超伝導トンネル接合(STJ)X 線検出器は、非常に薄い(~1nm)絶縁物からなるトンネル層を 2 枚の超伝導 層で挟んだ構造を持つデバイスである。我々は、絶縁層としてアルミニウム酸化膜(AlOx)、超伝導層とし てアルミニウム・ニオブ(Nb/Al)の多層膜を用いている。超伝導体は、バンドギャップがミリ eV オーダー で、半導体のバンドギャップ(eV オーダー)に比べ極めて小さいため、超伝導体を検出媒体として用い る STJ X 線検出器は、理論的には半導体検出器に比べ 20~30 倍という非常に高いエネルギー分解能が期 待できる。事実、当グループでは 4.1 eV@400 eV という半導体検出器の 10 倍以上のエネルギー分解能を 実現している。しかし STJ は、その高エネルギー分解能の維持のため、単一素子では高々100 µ m 角程度 の有感面積しか得る事が出来ず、その実用化に際し障害となっていたため、アレイ化による有感面積の拡 大が試みられてきた。当グループでは、これまでに世界最大規模の 512 素子 Nb/Al STJ アレイ X 線検出 器を開発し、~5mm²の有感面積を実現した。

一方、近年研究が進められている次世代機能性材料(GaN、SiC等の省エネルギー半導体や軽量合金、耐熱鋼等の構造材料等)の性能向上には、材料中のホウ素(B)、炭素(C)、酸素(O)、窒素(N)等の軽元素ド ーパント周辺の原子スケールの局所構造や、軽元素ドーパント自体の材料中での偏在状況をナノスケール で詳細に分析する必要がある。一般的にそのような目的には、励起されたドーパントからの蛍光 X 線を 利用するが、軽元素の場合、放出される蛍光 X 線は、ほぼそのエネルギーが 1keV 以下の軟 X 線となり、 既存のシリコンドリフト検出器(SDD)ではエネルギー分解能の点で、結晶分光器を用いる波長分散分 光法では検出感度の点で不十分なため、これまで軽元素ドーパントについて充分な知見を得ることが出来 なかった。そこで、SDD に対して約 10 倍のエネルギー分解能と、結晶分光器に対して数百倍の検出効率 を同時に実現する STJ アレイ X 線検出器を活用し、軽元素ドーパントについての未活用情報取得を可能 とするため、当グループでは 100 素子からなる STJ アレイ X 線検出器(有感面積:1mm²)を用いて、以 下の2 種類の先端計測機器を整備した。

- 1) 超伝導蛍光収量X線吸収微細構造分析装置(SC-XAFS)
- 2) 超伝導蛍光 X 線検出器付走查型電子顕微鏡(SC-SEM)

両装置は文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」(http://nanonet.mext.go.jp/)のもと既に共用 装置として公開され、実材料の分析に使用されている。次章では、これら各先端計測機器の概要及び測定 例について説明する。

2. STJ アレイ X 線検出器を用いた先端計測機器

2-1. 超伝導蛍光収量 X 線吸収微細構造分析装置(SC-XAFS)

本分析装置では、材料中の対象元素周辺の原子スケールの局所構造を調べるため蛍光収量 X 線吸収微細構造分析(FY-XAFS)を行う。FY-XAFS では、対象元素からの蛍光 X 線の発生量増大のため、試料に照射する X 線を高強度にする必要があるため、一般的に放射光施設において行われる。本装置も、高エネルギー加速器研究機構・放射光科学研究施設(KEK・PF)のビームライン(BL)に接続して使用される。(図.1)。 現在使用できるビームラインは BL-11A, BL-11B, BL-16A で、70 - 5000 eV の範囲が測定できる。これま

2017年秋の大会

で、SC-XAFS により n-SiC の N ドーパント(4 x 10⁻¹⁹ cm⁻³)の X 線吸収端近傍構造(XANES)測定に世界 で初めて成功した。500度で N をイオン注入した 4H-SiC 基板とその後熱処理した基板で実際に得られた XANES スペクトル(図.2)と原子構造を元に第1原理計算により得られるスペクトルを比較することによ

り、SiC へのドー ピングでは、イオ ン注入直後から殆 どのNがCサイト を置換しているこ とが判明し、アニ ールによりNの格 子位置置換が進む のではなく、アニ ールによる n-SIC





図.1 SC-XAFS 全体写真 図.2 n-SiC 中の

図.2 n-SiC 中の N の XANES スペクトル

の活性化は、むしろ欠陥回復が原因であることを示唆することとなった。

2-2. 超伝導蛍光 X 線検出器付走査型電子顕微鏡(SC-SEM)

本分析装置は、SDD等の半導体検出器の換わりに STJ アレイ X 線検出器を用いた SEM-EDS 装置(図.3) であり、材料中の微量元素の偏在状況を将来的にはナノスケールで分析するため開発した。ナノスケール の元素マッピングの為には、電子ビームの加速電圧を 1 keV 以下とし、蛍光 X 線の発生領域をナノスケー ルとする必要があるが、そのような条件下では、発生する蛍光 X 線のエネルギーも軟 X 線となるため、 STJ アレイ X 線検出器の高エネルギー分解能が、元素同定に必要な蛍光 X 線弁別の実現には必須である。 本装置の SEM は FE-SEM であり、加速電圧は 0.6 ~ 30keV、一般的な条件での解像度は 10nm 程度であ る。これまでに本分析装置で得られたデータを以下に示す。BN パウダーで得られた蛍光 X 線スペクトル を示す。(図.4) 本スペクトルでは B,C,N,O ピークが明瞭に分かれていることが分かる。次に、耐熱合金中 に存在する粒子状析出物(Inclusion)から得られた蛍光 X 線スペクトル(図.5)を示す。本スペクトルか ら半導体検出器では分離できない Cr と O の蛍光 X 線が分離出来ていることが分かる。また各 Inclusion で 得られる各蛍光 X 線ピークの強度変化から、その中に存在する N,O の量が一定ではない事も分かった。



図.3 SC-SEM 全体写真



3. 今後の展開

今後は、STJアレイ X 線検出器の更なる有感面積の拡大、エネルギー分解能の向上のため、アレイ数の 増大及び、STJ素子の層構造の改良に取り組み、SC-XAFS、SC-SEM の性能を向上させ、より多くの未活 用情報の取得を可能にしたい。更に、SC-XAFS、SC-SEM に加えて現在構築を進めている、超伝導蛍光X 線検出器付き粒子線励起X線分析装置(SC-PIXE)を完成させ、微量軽元素の高感度分析を実現したい。

^{*}Masahiro Ukibe¹, Shigetomo Shiki¹, Nobuyuki Zen¹, Go Fuji¹, Masataka Ohkubo¹, and Yoshinori Kitajima² ¹AIST, ²KEK.